

특허청구의 범위

청구항 1

기관;

상기 기관 상에 배치되는 이면전극층;

상기 이면전극층 상에 배치되는 광 흡수층;

상기 광 흡수층 상에 배치되는 윈도우층;

상기 이면전극층 및 상기 광 흡수층 사이에 개재되고 제 1 도전형 산화물을 포함하는 도전층; 및

상기 윈도우층으로부터 연장되며, 상기 도전층에 접속되는 접속부를 포함하고,

상기 광 흡수층에는 상기 도전층을 노출하는 관통홀이 형성되고,

상기 접속부는 상기 관통홀 내측에 배치되는 태양광 발전장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 도전형 산화물은 p형 산화물을 포함하는 태양광 발전장치.

청구항 3

기관;

상기 기관 상에 배치되는 이면전극층;

상기 이면전극층 상에 배치되는 광 흡수층;

상기 광 흡수층 상에 배치되는 윈도우층; 및

상기 이면전극층 및 상기 광 흡수층 사이에 개재되고 제 1 도전형 산화물을 포함하는 도전층을 포함하고,

상기 도전층은 나트륨을 포함하는 태양광 발전장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 도전층은 인듐 틴 옥사이드, 틴 옥사이드 또는 인듐 틴 징크 옥사이드를 포함하는 태양광 발전장치.

청구항 5

삭제

청구항 6

제 1 항에 있어서, 상기 접속부는 상기 도전층을 통하여, 상기 이면전극층에 접속되는 태양광 발전장치.

청구항 7

제 1 항에 있어서, 상기 도전층의 두께는 1nm 내지 200nm인 태양광 발전장치.

청구항 8

제 1 항에 있어서, 상기 광 흡수층은 상기 제 1 도전형 산화물과 같은 도전형을 가지는 물질을 포함하고,

상기 윈도우층은 제 2 도전형의 물질을 포함하는 태양광 발전장치.

청구항 9

기관 상에 이면전극층을 형성하는 단계;

상기 이면전극 상에 제 1 도전형 산화물을 증착하여 도전층을 형성하는 단계;

상기 도전층 상에 광 흡수층을 형성하는 단계;

상기 광 흡수층에 상기 도전층의 상면을 노출하는 관통홀을 형성하는 단계; 및

상기 광 흡수층 상에 윈도우층을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 윈도우층을 형성하는 단계에서, 상기 관통홀 내측에 투명한 도전물질을 증착하는 단계를 포함하는 태양광 발전장치의 제조방법.

청구항 10

제 9 항에 있어서, 상기 제 1 도전형 산화물은 인듐 틴 옥사이드, 틴 옥사이드 및 인듐 틴 징크 옥사이드로 구성되는 그룹으로부터 선택되고,

상기 광 흡수층은 I-III-IV족 화합물을 포함하는 태양광 발전장치의 제조방법.

청구항 11

삭제

명세서

기술분야

[0001] 실시예는 태양광 발전장치 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 최근 에너지의 수요가 증가함에 따라서, 태양광 에너지를 전기에너지로 변환시키는 태양광 발전장치에 대한 개발이 진행되고 있다.

[0003] 특히, 유리기관, 금속 후면 전극층, p형 CIGS계 광 흡수층, 고 저항 버퍼층, n형 윈도우층 등을 포함하는 기관 구조의 pn 헤테로 접합 장치인 CIGS계 태양광 발전장치가 널리 사용되고 있다.

[0004] 이러한 태양광 발전장치에 있어서 낮은 저항, 높은 투과율 등의 전기적인 특성을 향상시키기 위한 연구가 진행되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 실시예는 향상된 기계적 및 전기적인 특성을 가지는 태양광 발전장치 및 이의 제조방법을 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0006] 실시예에 따른 태양광 발전장치는 기관; 상기 기관 상에 배치되는 이면전극층; 상기 이면전극층 상에 배치되는 광 흡수층; 상기 광 흡수층 상에 배치되는 윈도우층; 및 상기 이면전극층 및 상기 광 흡수층 사이에 개재되고 제 1 도전형 산화물을 포함하는 도전층을 포함한다.

[0007] 실시예에 따른 태양광 발전장치의 제조방법은 기관 상에 이면전극층을 형성하는 단계; 상기 이면전극층 상에 제 1 도전형 산화물을 증착하여 도전층을 형성하는 단계; 상기 도전층 상에 광 흡수층을 형성하는 단계; 및 상기 광 흡수층 상에 윈도우층을 형성하는 단계를 포함한다.

발명의 효과

[0008] 실시예에 따른 태양광 발전장치는 이면전극층 및 광 흡수층 사이에 개재되는 도전층을 포함한다. 이때, 도전층이 도전성 산화물을 포함하는 경우, 도전층은 이면전극층 및 광 흡수층 모두에 높은 접착력을 가질 수 있다.

[0009] 따라서, 도전층은 이면전극층 및 광 흡수층 사이의 결합력을 강화시키고, 실시예에 따른 태양광 발전장치는

향상된 기계적인 특성을 가진다.

- [0010] 또한, 윈도우층 및 이면전극층은 접속부에 의해서 서로 연결될 수 있다. 이때, 접속부는 도전층을 통하여 이면전극층에 접속된다. 또한, 이면전극층이 형성된 후, 도전층이 바로 형성될 수 있기 때문에, 이면전극층 및 도전층 사이에 부수적인 반응에 의해서 형성된 접속 특성을 방해하는 물질이 개재되지 않는다. 따라서, 도전층 및 이면전극층 사이의 접속 특성이 향상된다. 또한, 도전층 및 접속부는 모두 도전성 산화물을 포함할 수 있다. 이에 따라서 접속부 및 도전층 사이의 접속 특성이 향상된다. 결과적으로, 도전층에 의해서, 접속부 및 이면전극층의 접속 특성이 향상된다.
- [0011] 또한, 도전층은 광 흡수층에 사용되는 CIGS계 화합물과 같은 도전형의 p형 산화물을 포함할 수 있다. 이에 따라서, 도전층은 광 흡수층과 이면전극층 사이의 접속 특성을 향상시킬 수 있다.
- [0012] 이에 따라서, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 향상된 전기적인 특성을 가진다.
- [0013] 또한, 도전층은 이면전극층을 덮는다. 따라서, 이면전극층은 도전층에 의해서 보호될 수 있다. 따라서, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 이면전극층의 부식을 방지하고, 향상된 내구성을 가진다.
- [0014] 또한, 도전층에는 나트륨이 포함될 수 있다. 도전층에 포함된 나트륨은 광 흡수층을 형성하는 과정에서 광 흡수층에 확산되어, 광 흡수층의 특성을 향상시킬 수 있다.
- [0015] 따라서, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 향상된 기계적 및 전기적인 특성을 가진다.

도면의 간단한 설명

- [0016] 도 1은 실시예에 따른 태양광 발전장치를 도시한 평면도이다.
- 도 2는 도 1에서 A-A'를 따라서 절단한 단면을 도시한 단면도이다.
- 도 3 내지 도 7은 실시예에 따른 태양광 발전장치를 제조하는 과정을 도시한 단면도들이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0017] 실시 예의 설명에 있어서, 각 기관, 층, 막 또는 전극 등이 각 기관, 층, 막, 또는 전극 등의 "상(on)"에 또는 "아래(under)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, "상(on)"과 "아래(under)"는 "직접(directly)" 또는 "다른 구성요소를 개재하여 (indirectly)" 형성되는 것을 모두 포함한다. 또한 각 구성요소의 상 또는 아래에 대한 기준은 도면을 기준으로 설명한다. 도면에서의 각 구성요소들의 크기는 설명을 위하여 과장될 수 있으며, 실제로 적용되는 크기를 의미하는 것은 아니다.
- [0018] 도 1은 실시예에 따른 태양광 발전장치를 도시한 평면도이다. 도 2는 도 1에서 A-A'선을 따라서 절단한 단면을 도시한 단면도이다.
- [0019] 도 1 및 도 2를 참조하면, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 지지기관(100), 이면전극층(200), 도전층(300), 광 흡수층(400), 버퍼층(500), 고저항 버퍼층(600), 윈도우층(700) 및 다수 개의 접속부들(800)을 포함한다.
- [0020] 상기 지지기관(100)은 플레이트 형상을 가지며, 상기 이면전극층(200), 상기 광 흡수층(400), 상기 버퍼층(500), 상기 고저항 버퍼층(600), 상기 윈도우층(700) 및 상기 접속부들(800)을 지지한다.
- [0021] 상기 지지기관(100)은 절연체일 수 있다. 상기 지지기관(100)은 유리기관, 플라스틱기관 또는 금속기관일 수 있다. 더 자세하게, 상기 지지기관(100)은 소다 라임 글래스(soda lime glass) 기관일 수 있다. 상기 지지기관(100)은 투명할 수 있다. 상기 지지기관(100)은 리지드하거나 플렉서블할 수 있다.
- [0022] 상기 이면전극층(200)은 상기 지지기관(100) 상에 배치된다. 상기 이면전극층(200)은 금속층일 수 있다. 상기 이면전극층(200)으로 사용되는 물질의 예로서는 폴리브텐 등의 금속을 들 수 있다.
- [0023] 또한, 상기 이면전극층(200)은 두 개 이상의 층들을 포함할 수 있다. 이때, 각각의 층들은 같은 금속으로 형성되거나, 서로 다른 금속으로 형성될 수 있다.
- [0024] 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200) 상에 배치된다. 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200)의 상면 전체를 덮는다. 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200)과 직접 접촉한다. 즉, 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200)에 직접적인 접촉에 의해서 접속된다.
- [0025] 또한, 상기 도전층(300)은 상기 광 흡수층(400)에 직접 접속된다. 즉, 상기 도전층(300)의 상면은 상기 광 흡수층(400)에 직접 접속된다.

수층(400)에 직접 접촉되고, 이에 따라서, 상기 도전층(300)은 상기 광 흡수층(400)에 접속된다.

- [0026] 상기 도전층(300)은 제 1 도전형 산화물을 포함한다. 예를 들어, 상기 도전층(300)은 p형 산화물을 포함한다. 상기 p형 산화물은 인듐 틴 옥사이드, 틴 옥사이드 및 인듐 틴 징크 옥사이드로 구성되는 그룹으로부터 선택될 수 있다.
- [0027] 상기 도전층(300)은 산화물을 포함하기 때문에, 안정하다. 즉, 산화물을 금속보다 더 화학적으로 안정되기 때문에 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200)보다 더 안정적이다. 이에 따라서, 상기 도전층(300)을 형성하는 과정에서 상기 이면전극층(200)을 이루는 물질과 상기 p형 산화물 사이의 부반응이 거의 일어나지 않는다.
- [0028] 이에 따라서, 상기 도전층(300) 및 상기 이면전극층(200) 사이의 결합력을 저해하는 부산물 등이 형성되지 않고, 상기 도전층(300) 및 상기 이면전극층(200) 사이의 결합력이 향상된다. 추가적으로, 상기 도전층(300) 및 상기 이면전극층(200) 사이의 접속 특성이 향상된다. 즉, 상기 도전층(300)은 높은 기계적 및 전기적 접속 특성을 가지며 상기 이면전극층(200)에 접속된다.
- [0029] 상기 도전층(300)에는 나트륨이 포함될 수 있다. 상기 도전층(300)에는 나트륨이 도펀트 형태로 도핑될 수 있다. 즉, 상기 p형 산화물에 나트륨이 도핑될 수 있다. 상기 이면전극층(200) 및 상기 광 흡수층(400)에도 나트륨이 포함될 수 있다. 이때, 상기 도전층(300)의 나트륨의 농도가 가장 높을 수 있다.
- [0030] 상기 도전층(300)의 두께는 약 1nm 내지 약 200nm일 수 있다. 상기 도전층(300)은 투명하며 낮은 저항을 가진다. 또한, 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200)과 동일하게 패터닝 될 수 있다.
- [0031] 상기 이면전극층(200) 및 상기 도전층(300)에는 제 1 관통홀들(TH1)이 형성된다. 상기 제 1 관통홀들(TH1)은 상기 지지기판(100)의 상면을 노출하는 오픈 영역이다. 상기 제 1 관통홀들(TH1)은 평면에서 보았을 때, 일 방향으로 연장되는 형상을 가질 수 있다.
- [0032] 상기 제 1 관통홀들(TH1)의 폭은 약 80 μ m 내지 200 μ m 일 수 있다.
- [0033] 상기 제 1 관통홀들(TH1)에 의해서, 상기 이면전극층(200)은 다수 개의 이면전극들로 구분된다. 즉, 상기 제 1 관통홀들(TH1)에 의해서, 상기 이면전극들이 정의된다.
- [0034] 상기 이면전극들은 상기 제 1 관통홀들(TH1)에 의해서 서로 이격된다. 상기 이면전극들은 스트라이프 형태로 배치된다.
- [0035] 이와는 다르게, 상기 이면전극들은 매트릭스 형태로 배치될 수 있다. 이때, 상기 제 1 관통홀들(TH1)은 평면에서 보았을 때, 격자 형태로 형성될 수 있다.
- [0036] 상기 광 흡수층(400)은 상기 이면전극층(200) 상에 배치된다. 또한, 상기 광 흡수층(400)에 포함된 물질은 상기 제 1 관통홀들(TH1)에 채워진다.
- [0037] 상기 광 흡수층(400)은 I-III-VI족 계 화합물을 포함한다. 예를 들어, 상기 광 흡수층(400)은 구리-인듐-갈륨-셀레나이드계(Cu(In,Ga)Se₂;CIGS계) 결정 구조, 구리-인듐-셀레나이드계 또는 구리-갈륨-셀레나이드계 결정 구조를 가질 수 있다.
- [0038] 상기 광 흡수층(400)의 에너지 밴드갭(band gap)은 약 1eV 내지 1.8eV일 수 있다.
- [0039] 상기 버퍼층(500)은 상기 광 흡수층(400) 상에 배치된다. 상기 버퍼층(500)은 황화 카드뮴(CdS)를 포함하며, 상기 버퍼층(500)의 에너지 밴드갭은 약 2.2eV 내지 2.4eV이다.
- [0040] 상기 고저항 버퍼층(600)은 상기 버퍼층(500) 상에 배치된다. 상기 고저항 버퍼층(600)은 불순물이 도핑되지 않은 징크 옥사이드(i-ZnO)를 포함한다. 상기 고저항 버퍼층(600)의 에너지 밴드갭은 약 3.1eV 내지 3.3eV이다.
- [0041] 상기 광 흡수층(400), 상기 버퍼층(500) 및 상기 고저항 버퍼층(600)에는 제 2 관통홀들(TH2)이 형성된다. 상기 제 2 관통홀들(TH2)은 상기 광 흡수층(400)을 관통한다. 또한, 상기 제 2 관통홀들(TH2)은 상기 도전층(300)의 상면을 노출하는 오픈영역이다.
- [0042] 상기 제 2 관통홀들(TH2)은 상기 제 1 관통홀들(TH1)에 인접하여 형성된다. 즉, 상기 제 2 관통홀들(TH2)의 일부는 평면에서 보았을 때, 상기 제 1 관통홀들(TH1)의 옆에 형성된다.
- [0043] 상기 제 2 관통홀들(TH2)의 폭은 약 80 μ m 내지 약 200 μ m 일 수 있다.

- [0044] 또한, 상기 광 흡수층(400)은 상기 제 2 관통홀들(TH2)에 의해서, 다수 개의 광 흡수부들을 정의한다. 즉, 상기 광 흡수층(400)은 상기 제 2 관통홀들(TH2)에 의해서, 상기 광 흡수부들로 구분된다.
- [0045] 상기 윈도우층(700)은 상기 고저항 버퍼층(600) 상에 배치된다. 상기 윈도우층(700)은 투명하며, 도전체이다. 또한, 상기 윈도우층(700)의 저항은 상기 이면전극층(200)의 저항보다 높다. 예를 들어, 상기 윈도우층(700)의 저항은 상기 이면전극층(200)의 저항보다 약 10배 내지 200배 더 클 수 있다.
- [0046] 상기 윈도우층(700)은 산화물을 포함한다. 예를 들어, 상기 윈도우층(700)은 알루미늄이 도핑된 징크 옥사이드(Al doped zinc oxide; AZO) 또는 갈륨 도핑된 징크 옥사이드(Ga doped zinc oxide; GZO) 등을 포함할 수 있다. 상기 윈도우층(700)의 두께는 약 800nm 내지 약 1200nm일 수 있다.
- [0047] 상기 버퍼층(500), 상기 고저항 버퍼층(600) 및 상기 윈도우층(700)에는 제 3 관통홀들(TH3)이 형성된다. 상기 제 3 관통홀들(TH3)은 상기 도전층(300)의 상면을 노출하는 오픈 영역이다. 예를 들어, 상기 제 3 관통홀들(TH3)의 폭은 약 80 μ m 내지 약 200 μ m일 수 있다.
- [0048] 상기 제 3 관통홀들(TH3)은 상기 제 2 관통홀들(TH2)에 인접하는 위치에 형성된다. 더 자세하게, 상기 제 3 관통홀들(TH3)은 상기 제 2 관통홀들(TH2) 옆에 배치된다. 즉, 평면에서 보았을 때, 상기 제 3 관통홀들(TH3)은 상기 제 2 관통홀들(TH2) 옆에 나란히 배치된다.
- [0049] 상기 버퍼층(500)은 상기 제 2 관통홀들(TH2) 및 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 의해서, 다수 개의 버퍼들로 구분된다.
- [0050] 마찬가지로, 상기 고저항 버퍼층(600)은 상기 제 2 관통홀들(TH2) 및 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 의해서, 다수 개의 고저항 버퍼들로 구분된다.
- [0051] 또한, 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 의해서, 상기 윈도우층(700)은 다수 개의 윈도우들로 구분된다. 즉, 상기 윈도우들은 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 의해서 정의된다.
- [0052] 상기 윈도우들은 상기 이면전극들과 대응되는 형상을 가진다. 즉, 상기 윈도우들은 스트라이프 형태로 배치된다. 이와는 다르게, 상기 윈도우들은 매트릭스 형태로 배치될 수 있다.
- [0053] 또한, 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 의해서, 다수 개의 셀들(C1, C2...)이 정의된다. 더 자세하게, 상기 제 2 관통홀들(TH2) 및 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 의해서, 상기 셀들(C1, C2...)이 정의된다. 즉, 상기 제 2 관통홀들(TH2) 및 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 의해서, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 상기 셀들(C1, C2...)로 구분된다.
- [0054] 상기 접속부들(800)은 상기 제 2 관통홀들(TH2) 내측에 배치된다. 상기 접속부들(800)은 상기 윈도우층(700)으로부터 하방으로 연장되며, 상기 도전층(300)에 접속된다. 더 자세하게, 상기 접속부들(800)은 상기 도전층(300)을 통하여, 상기 이면전극층(200)에 접속된다. 예를 들어, 상기 접속부들(800)은 상기 제 1 셀(C1)의 윈도우로부터 연장되어, 상기 도전층(300)을 통하여 상기 제 2 셀(C2)의 이면전극에 접속된다.
- [0055] 따라서, 상기 접속부들(800)은 서로 인접하는 셀들을 연결한다. 더 자세하게, 상기 접속부들(800)은 서로 인접하는 셀들에 각각 포함된 윈도우와 이면전극을 연결한다.
- [0056] 상기 접속부(800)는 상기 윈도우층(700)과 일체로 형성된다. 즉, 상기 접속부(800)로 사용되는 물질은 상기 윈도우층(700)으로 사용되는 물질과 동일하다.
- [0057] 앞서 설명한 바와 같이, 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200) 및 상기 광 흡수층(400) 모두에 높은 접착력을 가질 수 있다. 따라서, 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200) 및 상기 광 흡수층(400) 사이의 결합력을 강화시키고, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 향상된 기계적인 특성을 가진다.
- [0058] 또한, 앞서 설명한 바와 같이, 상기 도전층(300) 및 상기 이면전극층(200)은 높은 접속 특성을 가지며 접속된다. 상기 도전층(300) 및 상기 접속부(800)는 모두 도전성 산화물을 포함하기 때문에, 상기 접속부(800) 및 상기 도전층(300) 사이의 접속 특성이 향상된다. 결과적으로, 상기 도전층(300)에 의해서, 상기 접속부(800) 및 상기 이면전극층(200)의 접속 특성이 향상된다.
- [0059] 또한, 상기 도전층(300)은 상기 광 흡수층(400)에 사용되는 CIGS계 화합물과 같은 도전형의 p형 산화물을 포함할 수 있다. 따라서, 상기 도전층(300)은 상기 광 흡수층(400)에 향상된 접속 특성을 가지며 접속되고, 상기 도전층(300)은 상기 광 흡수층(400)과 상기 이면전극층(200) 사이의 접속 특성을 향상시킬 수 있다.

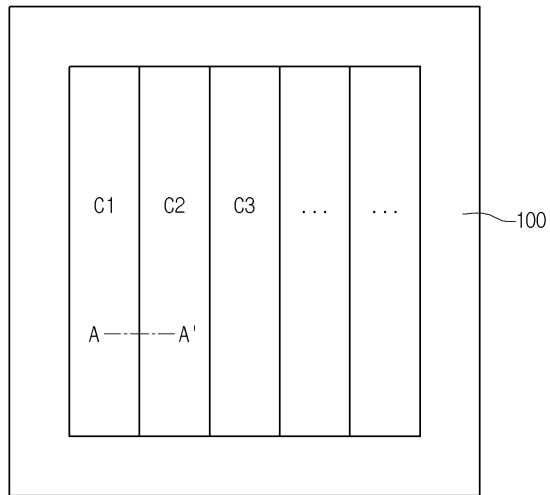
- [0060] 이에 따라서, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 향상된 전기적인 특성을 가진다.
- [0061] 또한, 상기 이면전극층(200)은 상기 도전층(300)에 의해서 보호될 수 있다. 더 자세하게, 상기 이면전극층(200)에서 상기 제 3 관통홀들(TH3)에 노출되는 부분을 상기 도전층(300)이 덮는다. 따라서, 상기 도전층(300)은 상기 이면전극층(200)의 부식을 방지하고, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 향상된 내구성을 가진다.
- [0062] 또한, 상기 도전층(300)에는 나트륨이 포함될 수 있다. 상기 도전층(300)에 포함된 나트륨은 상기 광 흡수층(400)을 형성하는 과정에서 상기 광 흡수층(400)에 확산되어, 상기 광 흡수층(400)의 특성을 향상시킬 수 있다.
- [0063] 따라서, 실시예에 따른 태양광 발전장치는 향상된 기계적 및 전기적인 특성을 가진다.
- [0064] 도 3 내지 도 7은 실시예에 따른 태양광 발전장치를 제조하는 과정을 도시한 단면도들이다. 본 제조 방법에 대한 설명에서는 앞서 설명한 태양광 발전장치에 대한 설명을 참조한다. 즉, 앞서 설명한 태양광 발전장치에 대한 설명은 본 제조 방법에 관한 설명에 본질적으로 결합될 수 있다.
- [0065] 도 3을 참조하면, 지지기판(100) 상에 이면전극층(200)이 형성된다. 상기 이면전극층(200)은 몰리브덴 타겟을 사용하는 스퍼터링 공정에 의해서 형성될 수 있다. 상기 이면전극층(200)의 두께는 약 100nm 내지 약 500nm일 수 있다.
- [0066] 또한, 상기 지지기판(100) 및 상기 이면전극층(200) 사이에 확산방지막 등과 같은 추가적인 층이 개재될 수 있다.
- [0067] 이후, 상기 이면전극층(200) 상에 도전층(300)이 형성된다.
- [0068] 상기 도전층(300)은 스퍼터링 공정에 의해서 형성될 수 있다. 상기 도전층(300)은 p형 산화물을 포함하는 스퍼터링 타겟을 사용하여 형성될 수 있다. 또한, 상기 스퍼터링 타겟에는 나트륨이 도핑될 수 있다. 즉, 상기 스퍼터링 타겟으로 나트륨이 도핑된 p형 산화물이 사용될 수 있다.
- [0069] 상기 스퍼터링 타겟으로 사용되는 물질의 예로서는 나트륨이 도핑된 인듐 틴 옥사이드, 나트륨이 도핑된 틴 옥사이드 또는 나트륨이 도핑된 인듐 틴 징크 옥사이드 등을 들 수 있다.
- [0070] 상기 도전층(300)은 약 1nm 내지 약 200nm의 두께로 증착될 수 있다. 상기 도전층(300)에는 나트륨이 도핑될 수 있다. 이때, 상기 스퍼터링 타겟에 도핑되는 나트륨의 농도는 상기 도전층(300)의 두께에 따라서 달라질 수 있다. 즉, 상기 도전층(300)의 두께가 얇아지는 경우에는 상기 도핑된 나트륨의 농도가 높아질 수 있다. 반대로, 상기 도전층(300)의 두께가 두꺼운 경우에는 상기 도핑된 나트륨의 농도는 낮아질 수 있다.
- [0071] 이후, 상기 이면전극층(200) 및 상기 도전층(300)에는 레이저에 의해서 다수 개의 제 1 관통홀들(TH1)이 형성된다. 즉, 상기 이면전극층(200) 및 상기 도전층(300)은 동시에 패터닝된다. 이에 따라서, 상기 이면전극층(200)은 상기 제 1 관통홀들에 의해서 다수 개의 이면전극들로 구분된다.
- [0072] 상기 제 1 관통홀들(TH1)은 상기 지지기판(100)의 상면을 노출하며, 약 80 μ m 내지 약 200 μ m의 폭을 가질 수 있다.
- [0073] 도 4를 참조하면, 상기 도전층(300) 상에 광 흡수층(400), 버퍼층(500) 및 고저항 버퍼층(600)이 형성된다.
- [0074] 상기 광 흡수층(400)은 스퍼터링 공정 또는 증발법 등에 의해서 형성될 수 있다.
- [0075] 예를 들어, 상기 광 흡수층(400)을 형성하기 위해서 구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄을 동시 또는 구분하여 증발시키면서 구리-인듐-갈륨-셀레나이드계(Cu(In,Ga)Se₂;CIGS계)의 광 흡수층(400)을 형성하는 방법과 금속 프리커서 막을 형성시킨 후 셀레니제이션(Selenization) 공정에 의해 형성시키는 방법이 폭넓게 사용되고 있다.
- [0076] 금속 프리커서 막을 형성시킨 후 셀레니제이션 하는 것을 세분화하면, 구리 타겟, 인듐 타겟, 갈륨 타겟을 사용하는 스퍼터링 공정에 의해서, 상기 이면전극(200) 상에 금속 프리커서 막이 형성된다.
- [0077] 이후, 상기 금속 프리커서 막은 셀레니제이션(selenization) 공정에 의해서, 구리-인듐-갈륨-셀레나이드계(Cu(In,Ga)Se₂;CIGS계)의 광 흡수층(400)이 형성된다.
- [0078] 이와는 다르게, 상기 구리 타겟, 인듐 타겟, 갈륨 타겟을 사용하는 스퍼터링 공정 및 상기 셀레니제이션 공정

은 동시에 진행될 수 있다.

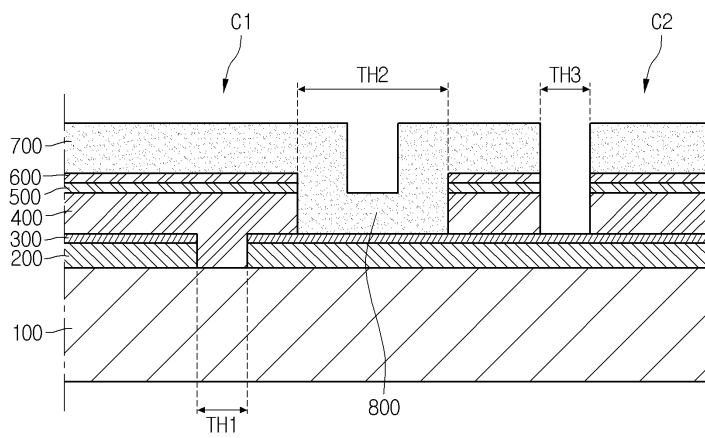
- [0079] 이와는 다르게, 구리 타겟 및 인듐 타겟 만을 사용하거나, 구리 타겟 및 갈륨 타겟을 사용하는 스퍼터링 공정 및 셀레니제이션 공정에 의해서, CIS계 또는 CIG계 광 흡수층(400)이 형성될 수 있다.
- [0080] 이후, 황화 카드뮴이 스퍼터링 공정 또는 용액성장법(chemical bath depositon; CBD) 등에 의해서 증착되고, 상기 버퍼층(500)이 형성된다.
- [0081] 이후, 상기 버퍼층(500) 상에 징크 옥사이드가 스퍼터링 공정 등에 의해서 증착되고, 상기 고저항 버퍼층(600)이 형성된다.
- [0082] 상기 버퍼층(500) 및 상기 고저항 버퍼층(600)은 낮은 두께로 증착된다. 예를 들어, 상기 버퍼층(500) 및 상기 고저항 버퍼층(600)의 두께는 약 1nm 내지 약 80nm이다.
- [0083] 이후, 상기 광 흡수층(400), 상기 버퍼층(500) 및 상기 고저항 버퍼층(600)의 일부가 제거되어 제 2 관통홀들(TH2)이 형성된다.
- [0084] 상기 제 2 관통홀들(TH2)은 팁 등의 기계적인 장치 또는 레이저 장치 등에 의해서 형성될 수 있다.
- [0085] 예를 들어, 약 40 μ m 내지 약 180 μ m의 폭을 가지는 팁에 의해서, 상기 광 흡수층(400) 및 상기 버퍼층(500)은 패터닝될 수 있다. 또한, 상기 제 2 관통홀들(TH2)은 약 200 내지 600nm의 파장을 가지는 레이저에 의해서 형성될 수 있다.
- [0086] 이때, 상기 제 2 관통홀들(TH2)의 폭은 약 80 μ m 내지 약 200 μ m 일 수 있다. 또한, 상기 제 2 관통홀들(TH2)은 상기 도전층(300)의 상면의 일부를 노출하도록 형성된다.
- [0087] 도 5를 참조하면, 상기 광 흡수층(400) 상 및 상기 제 2 관통홀들(TH2) 내측에 윈도우층(700)이 형성된다. 즉, 상기 윈도우층(700)은 상기 고저항 버퍼층(600) 상 및 상기 제 2 관통홀들(TH2) 내측에 투명한 도전물질이 증착되어 형성된다. 더 자세하게, 상기 윈도우층(700)은 알루미늄이 도핑된 징크 옥사이드가 증착되어 형성될 수 있다.
- [0088] 이때, 상기 제 2 관통홀들(TH2) 내측에 상기 투명한 도전물질이 채워지고, 상기 윈도우층(700)은 상기 도전층(300)에 직접 접촉하게 된다. 이에 따라서, 상기 제 2 관통홀들 내측에 접속부들(800)이 각각 형성된다.
- [0089] 도 6을 참조하면, 상기 버퍼층(500), 상기 고저항 버퍼층(600) 및 상기 윈도우층(700)의 일부가 제거되어 제 3 관통홀들(TH3)이 형성된다. 이에 따라서, 상기 윈도우층(700)은 패터닝되어, 다수 개의 윈도우들 및 다수 개의 셀들(C1, C2...)이 정의된다. 상기 제 3 관통홀들(TH3)의 폭은 약 80 μ m 내지 약 200 μ m 일 수 있다.
- [0090] 상기 제 3 관통홀들(TH3)은 상기 도전층(300)의 상면을 노출하며 형성된다. 이때, 상기 도전층(300)은 산화물로 형성되어, 상기 이면전극층(200)을 효율적으로 보호할 수 있다. 즉, 상기 도전층(300)은 상기 제 3 관통홀들에 의해서, 상기 이면전극층(200)이 외부에 노출되는 것을 방지한다.
- [0091] 이와 같이, 상기 도전층(300)을 포함하는 태양광 발전장치가 형성된다. 실시예에 따른 태양광 발전장치는 향상된 전기적인 특성 및 기계적인 특성을 가진다.
- [0092] 또한, 이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
- [0093] 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

도면

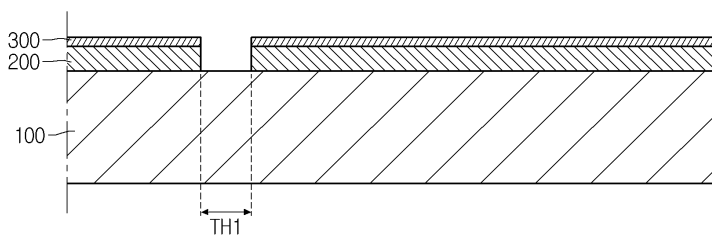
도면1



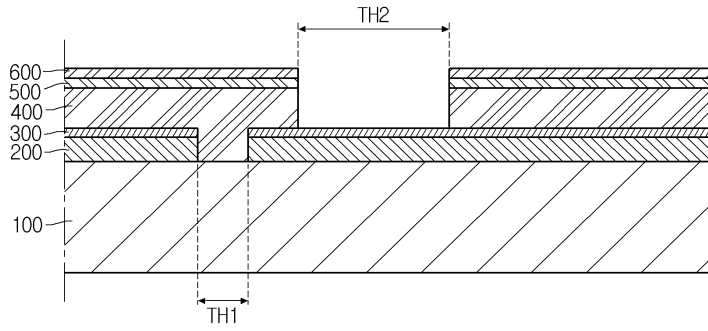
도면2



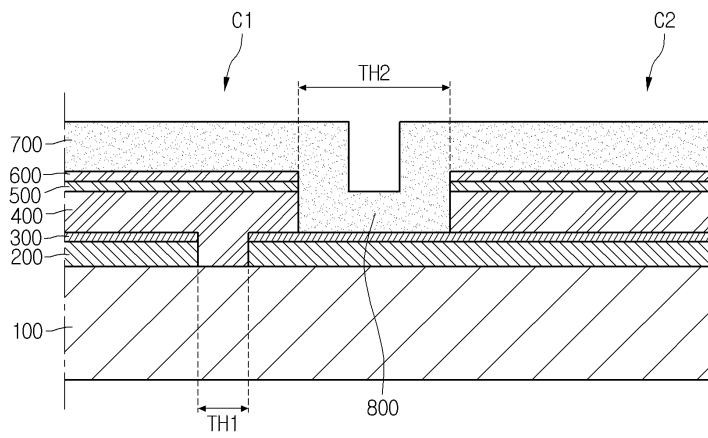
도면3



도면4



도면5



도면6

